「第17回マイクロマシン展」過去最大規模で開催予定

「第17回マイクロマシン展ー超精密・微細加工、MEMS、ナノテク、バイオに関する国際展示会」を11月７日（火）から11月９日（木）の３日間にわたり開催します。

今年は従来の科学技術館から東京国際フォーラム（東京・有楽町）に会場を移して開催します。最近のマイクロマシン・MEMS・ナノテク分野の発展による出展者の急増を受け、より広い展示スペースを確保するために開催場所を移しました。

前回の出展者（259企業・団体、362小間）を凌ぐ、約280企業・団体（約430小間）が出展の予定で、過去最大規模となる見込みです。

本展示会は、超精密・微細加工、MEMS（微小電気機械システム）、ナノテクノロジーに関する新技術・新製品の発表が行われる国内最大規模の展示会です。ご期待の上、ご参加下さい。

展示会事務局では、無料招待券を配布しておりますので、お問合せは、メサゴ・メッセフランクフルト（株）（TEL：03-3262-8456）まで。また、ホームページ（http：//www.micromachine.jp）からも展示会来場の事前登録が可能です。

H18年度　ＭＥＭＳ国際標準化ワークショップ＆プログラム

MEMS分野において国際標準化への戦略的展開を意図し、マイクロナノ2006イベントの一環として「MEMS国際標準化ワークショップ」を開催することとなりました。本ワークショップは世界的に最も先端的かつ優れた成果を出している研究者を招聘し、MEMSに関するマイクロ／ナノ技術と評価の最前線を講演して頂くとともに各国との相互理解を深めることを目的として開催するものであります。

■開催日時　2006年11月６日（月）10：00〜16：25
■開催場所　三菱ビル コンファレンススクエアM+ 10F
（東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル10F）
http://www.emplus.jp/access/
■参 加 費　無料　（講演は英語で行われます）
■主　　催　（財）マイクロマシンセンター
MEMS国際標準化ワークショップ実行委員会
■共　　催　（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構
■後　　援　経済産業省

session　1　　開会

10：00-　開催挨拶　ワークショップ実行委員長　東京工業大学　肥後矢吉　教授
10：05-　主催者挨拶　独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構　小澤純夫　部長

session　2　　MEMSデバイスの最前線

10：10-　“Glass Properties for Electrostatic Bonding in Process of the Packaging of MEMS Devices”
Prof. Dr. Sekwang Park （Kyunpook National University, Korea）
10：40-　“CNT Nano Electromechanical Transducers”
Prof. Dr. Christofer Hierold （ETH Zurich, Switzerland）
11：10-　“MEMS-based Nanopatterning： New Challenges and Opportunities for Materials Science”
Prof. Juergen Brugger （EPFL, Switzerland）
11：40-　ー 昼食 lunch ー

session　3　　MEMS評価法と標準化

13：00-　“MEMS Standardization Project at NIST”
Dr. Michael Gaitan （National Institute of Standards and Technology, U.S.A.）
13：30-　“Measurement of Micro-Tensile Properties for Gold Thin Film Using Micro-ESPI Technology”
Dr. Yong-Hak Huh （Korea Research Institute of Standards and Science, Korea）
14：00-　“Mechanical Material Characterization at the MEMS Materials Laboratory of IMTEK”
Prof. Dr. Oliver Paul （University of Freiburg, Germany）
14：30-　ー 休憩 Break ー
14：50-　“Deformation and Fatigue Mechanisms of Structural Films”
Prof. Christopher L. Muhlstein （The Pennsylvania State University, U.S.A.）
15：20-　“Round-Robin Test on Fatigue of Thin Films for MEMS Applications in Japan”
Prof. Kazuki Takashima （Kumamoto University, Japan）
15：50-　“A Comprehensive Assessment of Fatigue Failure in Micron-Scale Polycrystalline Silicon Structural Films for MEMS”
Prof. Robert O. Ritchie （University of California at Berkeley, U.S.A.）

session　4　　閉会

16：20-　閉会挨拶　MMC標準化事業委員会　大山尚武委員長